



第270回 OPERA研究交流セミナー

第261回 ISIT有機光エレクトロニクス研究特別室セミナー

第328回 未来化学創造センターセミナー



日時:2026年1月19日(月) 17:00～

場所:ISI棟3階 セミナー室

「半導体の微細化とフォトレジスト」

栗山 敬祐 氏

JSR株式会社 R&D部門 組織開発担当

JSRは合成ゴムの国策会社としてスタートしたが、近年では培った高分子技術を基に半導体製造に不可欠な材料群を供給するトップメーカーへと変貌している。本講演会では半導体における微細化の意義を紹介するとともに、微細化を支えるフォトリソグラフィ技術とそこで使用されるフォトレジスト（感光性樹脂）について分かり易く解説する。生成AIの基盤となる半導体の進化に、材料技術者が大きく貢献していることを紹介する。

主催:九州大学 最先端有機光エレクトロニクス研究センター
:財団法人九州先端科学技術研究所(ISIT)

共催:九州大学 未来化学創造センター